

九州大学超顕微解析研究センター使用規程

平成18年度九大規程第57号
制 定：平成19年 3月30日
最終改正：令和 6年 7月22日
(令和6年度九大規程第19号)

(趣旨)

第1条 この規程は、九州大学学内共同教育研究センター規則(平成26年度九大規則第92号)第22条の規定に基づき、超顕微解析研究センター(以下「センター」という。)の設備等の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 センターの設備等の使用を希望する者は、所定の申込書によりセンター長に申請し、その許可を得なければならない。

(使用者の義務)

第3条 設備の使用者(以下「使用者」という。)は、センターの利用心得及び職員の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって設備を利用しなければならない。

(損害賠償)

第4条 使用者が、その責めに帰すべき事由により、施設の設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第5条 使用者は、別表1、別表2又は別表3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、経費の振替又は本学が指定する口座へ振込により、所定の期日までに支払わなければならない。

3 既納の使用料は、原則として返還しない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターの設備等の使用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年度九大規程第50号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年度九大規程第104号)

この規程は、平成23年1月27日から施行する。

附 則(平成24年度九大規程第140号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年度九大規程第100号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年度九大規程第16号)

この規程は、平成26年8月25日から施行する。

附 則(平成26年度九大規程第97号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年度九大規程第13号)

この規程は、平成27年7月2日から施行する。

附 則(平成28年度九大規程第12号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

附 則(平成30年度九大規程第59号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

附 則(令和元年度九大規程第69号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和4年度九大規程第41号)

この規程は、令和5年1月16日から施行する。

附 則（令和4年度九大規程第77号）

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附 則（令和5年度九大規程第25号）

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

附 則（令和6年度九大規程第19号）

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

別表1 (第5条第1項関係)

設 備 等 名	使用1枠当たりの使用料 (1枠は下記の区分の4時間)
	10:00~14:00
	14:30~18:30
	19:00~23:00
超高压電子顕微鏡 JEM-1300NEF	15,000円
マイクロカロリメータSEM TES+ULTRA55	7,700円 (備考) 本機器使用の際、液体ヘリウムを使用する場合は、実費徴収とする。
収差補正走査/透過電子顕微鏡 JEM-ARM200F	14,000円
デュアルビームFIB Quanta 3D 200i	13,000円
ハイコントラスト補助電子顕微鏡 JEM-2100HCKM	6,100円
広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡 JEM-ARM200CF	15,000円
ホログラフィー電子顕微鏡 HF-3300X	11,000円
汎用電子顕微鏡 JEM-2100F	9,000円
電子顕微鏡用隔膜型ガス雰囲気試料ホルダー	5,000円 (備考) 本機器使用に係るMEMSチップ、特殊なガス(窒素、アルゴン、酸素及び水素を除く。)及び未使用のキャピラリーは含まない。 なお、本機器使用の際、MEMSチップを使用する場合は、実費徴収とし、未使用のキャピラリーは、使用者が持参し、当該費用は使用者の自己負担とする。
クロスセクションポリッシャ IB-19530CP	2,500円
グローブボックス UN-1000L-AGI	7,000円

別表2 (第5条第1項関係)

設備等名	使用1枠当たりの使用料	
	下記の区分の1枠(4時間)当たり	下記の区分の1枠(10時間)当たり
	10:00~14:00	23:00~翌9:00
	14:30~18:30	
19:00~23:00		
直交型FIB-SEM MI4000L	19,000円	46,000円
イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工分析装置(Helios5UX) (備考) 本機器使用の際、冷却加工のため窒素ガスを使用する場合は、実費徴収とする。	24,000円	59,000円

別表3 (第5条第1項関係)

設備等名	利用料
研磨・薄片化装置 ・PIPS II M-695 ・Nano MILL Model 1040 ・イオンスライサEM-09100IS	1,100円 (1枠(4時間)当たり) (備考) 各設備使用ごとに料金を徴収する。
コーティング装置 ・イオンコーター JFC-1600 ・カーボンコーター EC 32010CC	500円 (1件当たり) (備考) 各設備使用ごとに料金を徴収する。

※装置の割当てについては使用状況等に応じて本学が決定するものとする。